

第44回総務委員会議事要録

日 時：2020年3月14日(土) 13:00~15:30

場 所：筑波大学東京キャンパス 558 講義室

出席者：山口進会長，他7名

1. 審議事項

- ・定時総会(3月28日開催予定)の議題および資料について確認した。
- ・新型コロナウイルス感染防止のため，委員総会および懇親会は中止とした。
- ・新任の委員について承認された。
- ・2019年度の決算と2020年度予算について説明があり，収入増加および支出の削減策について議論された。
- ・OPJ 2020の進捗状況について報告された。
- ・冬期講習会の開催報告がなされた。
- ・産学連携専門委員会の内規案策定について報告された。
- ・光学論文賞の募集開始について報告された。

2. 報告事項

- ・「光学」編集委員会および光光委員会(関東・関西)委員の報告について
- ・Optical Reviewの掲載料請求状況について
- ・OPJ 2019の収支報告について
- ・コニカミノルタ光みらい奨励金の最終報告について
- ・会員数の推移について
- ・新規賛助会員の入会について

第45回総務委員会議事要録

日 時：2020年5月16日(土) 13:00~18:00

場 所：Web会議

出席者：山口進会長，他18名

1. 審議事項

- ・2020年度理事の役割が確認された。
- ・第45回光学シンポジウムの予算案，開催形態などについて議論された。
- ・第47回冬期講習会の開催形式などについて議論された。
- ・イベント別会計収支の年次推移について分析と課題が報告された。
- ・会員数の推移について報告され，増員への取り組みに関して議論された。
- ・授賞関係に関して，各賞の担当などが報告された。

2. 報告事項

- ・「光学」の新任編集委員について
- ・Optical Reviewの編集委員の今年度の体制について
- ・第46回冬期講習会の収支報告について

第46回総務委員会議事要録

日 時：2020年7月4日(土) 13:30~16:00

場 所：Web会議

出席者：山口進会長，他15名

1. 審議事項

- ・OPJ 2020に関して，オンラインでの開催が承認された。
- ・第47回冬期講習会の進捗について，報告と意見交換がなされた。
- ・会計に関して，研究グループとの消費税，法人税の案分について議論がなされた。
- ・「光とレーザーの科学技術フェア」のセミナーテーマを決定した。
- ・第46回光学シンポジウムの企画案について報告された。

2. 報告事項

- ・光学論文賞選考状況について
- ・光学奨励賞選考状況について
- ・コニカミノルタ光みらい奨励金の進捗について
- ・第45回光学シンポジウム開催報告について
- ・研究グループ代表者会議・支部運営委員会の議事内容について
- ・Optical Reviewの投稿料請求状況について
- ・会員数の推移について

第47回総務委員会議事要録

日 時：2020年9月19日(土) 13:00~17:00

場 所：Web会議

出席者：山口進会長，他12名

1. 審議事項

- ・光学論文賞候補論文2件の選考結果について報告され，承認された。
- ・光学奨励賞選考結果について報告され，承認された。
- ・コニカミノルタ光みらい奨励金の選考結果について報告され，承認された。
- ・OPJ 2020について授賞式の日程を確認した。ポス

ター、元幹事長との懇談会などの詳細に関しては、別途時間を設けて議論することとした。また、AI Optics 優秀賞について提案され、承認された。

- OPJ 2021 について会場に関する議論を行った。
- 第 46 回光学シンポジウムについて日時、場所、体制が報告された。
- 第 47 回冬期講習会についての進捗と今後の日程が報告された。
- 2021 年の年間テーマについて議論を行った。
- メーリングリストの運用について、内規に従い、公募情報は流さないことで合意した。
- Optical Review の掲載料について、未納者削減のための対策を検討した。
- Dropbox のアクセス権について方針を検討した。

2. 報告事項

- 「光学」の出版費用について
- Optical Review の Scope に関する修正について
- 会員数の推移について

第 46 回光学シンポジウム「実用的な最先端の光学設計/光計測/光学素子/光学システム」講演募集

光学シンポジウムは、光学設計者・技術者の皆様が日頃の研究、開発の成果を発表し、討論する場として、毎年開催されています。本年も下記の要領で第 46 回光学シンポジウムを開催いたします。多数の皆様の積極的な応募をお願いいたします。

期 日：2021 年 6 月 23 日(水)～25 日(金)

開催形態：オンライン開催

主 催：日本光学会

共 催：応用物理学会フォトニクス分科会 (予定)

応募講演の性格および内容：a) 原則として未発表のものとします。ただし、既発表のものの一部重複があっても、光学に関わる新規な内容が含まれていれば発表可能です。b) 内容は、光学システムおよび光学素子の設計、製作、評価に関連した講演を中心として、日本光学会の活動の全分野を対象とします。特に、これに関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎し、また問題提起の講演も認めます。

応募資格：日本光学会 (入会予定含む)、応用物理学会、SPIE、OSA、OSK、および協賛の学協会会員

応募方法：以下のホームページの講演応募方法をご参照の上、電子メールにてご応募ください。

URL http://myosj.or.jp/event2/opt_symp

応募先：光学シンポジウム実行委員会講演担当宛

E-mail optsymp46-sp@myosj.or.jp

応募締切：2021 年 3 月 8 日(月) 必着

予稿提出：採用した講演については、所定のフォーマットで PDF 形式の電子ファイルを提出していただきます。詳細は、後日案内予定の予稿原稿の書き方、ホームページをご参照ください。

予稿締切：2021 年 4 月 19 日(月) 必着

問合せ先：ホームページから、または下記連絡先をお願いします。

実行委員長 須藤芳文 (リコー)

E-mail optsymp46-aud@myosj.or.jp

第 24 回光設計賞募集

光設計研究グループでは、光設計分野における技術交流・研究活性化を目的として、「光設計賞」を実施しています。光設計賞は光に関わる各種デバイスやシステムの研究・開発に携わる方の自薦の賞です。皆様が研究・開発された成果(製品・論文・特許など)を応募用紙にアピールして、ご応募ください。全応募について審査委員会にて厳正に審査し、授賞します。

技術領域：「光設計」に関する研究、技術、発明など全般
審査項目：将来性、実用性、独創性の 3 つの観点で審査します。

表彰：光設計大賞 (1 件) 10 万円、光設計優秀賞 (若干数) 3 万円

表彰時期：2021 年度秋

応募方法：応募の詳細は下記 URL をご覧ください。

応募期間：2020 年 11 月 17 日～2021 年 4 月 30 日 (事前応募締切)、2021 年 5 月 31 日必着 (書類締切)

主 催：日本光学会光設計研究グループ

問合せ先：日本光学会光設計研究グループ光設計賞担当

E-mail odp24@opticsdesign.gr.jp

URL <http://www.opticsdesign.gr.jp/hikari.html>

Laser Display and Lighting Conference 2021 (LDC 2021)

Laser Display and Light Conference 2021 (LDC 2021) は今年で第 10 回を迎えます。レーザーディスプレイおよびレーザー照明に関わる、基礎研究からシステム・アプリケーションまでの幅広い分野をカバーしており、それらの技術・応用に関する科学・技術情報の発信・共有の場としてぜひご活用ください。

期 日：2021 年 4 月 19 日(月)～22 日(木)

開催形態：オンライン開催

協 賛： 日本光学会，応用物理学会，レーザー学会ほか
申 込： LDC 2021 ホームページをご覧ください
URL <https://ldc.opicon.jp/>

JOEM「画像情報処理と機械学習」技術講座

日 時： 2021年5月24日(月)，25日(火) 10：00～17：00
講 師： 長橋 宏（東京工業大学名誉教授）
場 所： ハイブリッド（対面＋オンライン Microsoft
Teams 利用）での開催
主 催： 日本オプトメカトロニクス協会

協 賛： 日本光学会，応用物理学会，日本光学工業協会
ほか
参加費： 協賛 80,410 円（テキスト・消費税含む）
定 員： 15 名（うち対面は 10 名となります）
申込期限： 2021 年 5 月 14 日(金)
問合せ先： 一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会
電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567
E-mail info@joem.or.jp URL <http://www.joem.or.jp>

日本光学会 news の掲載申込先：

日本光学会 光学広報担当 E-mail koho@myosj.or.jp

メールの件名に「日本光学会 news 原稿」と記載してください。

なお，掲載申込は原則として発行日（10 日）から 2 か月前の 15 日まで，開催日が 1～10 日の場合は，開催日の 3 か月前の 15 日までをお願いします。

掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください。

「レーザー研究」第 49 巻第 1 号 (2021 年 1 月号) 目次

「高出力レーザー駆動衝撃波の利活用の最前線」特集号

レーザーコンパス

レピュテーションを高めるために…………… 田邊孝純 (3)

《特集》

レーザー解説

「高出力レーザー駆動衝撃波の利活用の最前線」特集号によせて…………… 重森啓介 (5)

材料加工データベース創出のための 100 J 級半導体レーザー
励起 Yb:YAG セラミクスレーザーの進展

…………… 関根尊史, 栗田隆史, 栗田典夫, 川嶋利幸 (6)

ナノ秒レーザー駆動衝撃波の制御と加工への応用

…………… 弘中陽一郎, 三浦永祐, 宮西宏併, 尾崎典雅,
重森啓介, 栗田隆史, 黒田隆之助 (11)

X 線自由電子レーザーを用いたレーザーピーニングにおける
相変態の観察…………… 宮西宏併, 栗田隆史, 弘中陽一郎,

尾崎典雅, 三浦永祐, 重森啓介 (17)

レーザーピーニングの加工効率向上に関する研究

…………… 津山美穂 (22)

フェムト秒レーザー駆動衝撃波を利用した表面改質

—ドライレーザーピーニングによる疲労特性改善—

…………… 佐野智一 (28)

高強度レーザーを用いた惑星物質の衝撃圧縮実験

…………… 奥地拓生, 尾崎典雅 (35)

レーザー生成高速電子を用いた超高圧力発生

…………… 重森啓介, 弘中陽一郎, 尾崎典雅 (40)

レーザーオリジナル

レーザーピーニングにおける圧縮残留応力分布の解析的予測
手法…………… 壁谷悠希, 栗田隆史, 渡利威士,

吉村 涼, 栗田典夫 (45)

種々のアルミニウム合金におけるレーザーピーニング効果

…………… 吉池勝大, 岡遼太郎, 豊藏 森,
Noor Shahira binti MASROON, 部谷 学, 津山美穂, 中野人志 (50)

高強度レーザーと X 線自由電子レーザーによる炭酸塩鉱物天体
衝突再現実験…………… 梅田悠平, 福井敬也, 関根利守,

Alessandra Benuzzi-Mounaix, Marco Guarguaglini ほか (56)

一般論文

TGG セラミクスを用いた高平均出力レーザー用大口径

ファラデー回転装置の開発

…………… 吉田英次, 時田茂樹, 椿本孝治, 河仲準二 (61)

宇宙太陽光励起レーザーの増幅システム最適化設計

…………… 大澤健人, 金邊 忠 (67)

著者紹介

(74)

セルフフォーカス

(77)

「応用物理」第 90 巻第 3 号 (2021 年 3 月号) 予定目次

解説

超伝導ナノワイヤ単一光子検出器…………… 寺井弘高
マイクロ固体フォトニクスによる小型集積レーザー

—ビッグサイエンスから社会実装にわたるイノベーション

“ジャイアント・マイクロフォトニクス”に向けて—

…………… 平等拓範

研究紹介

フォトニック結晶を用いた熱輻射制御

…………… 浅野 卓, 末光真大, 井上卓也, 野田 進

ダイヤモンド放熱基板を用いた GaN-HEMT の開発

…………… 檜座秀一, 西村邦彦, 柳生栄治, 山向幹雄

磁性絶縁体中のスピン波位相干渉を用いた論理デバイス

…………… 後藤太一

暗闇における無機半導体の異常な室温可塑性と変形に伴う物性
変化…………… 中村篤智, 大島 優, 松永克志

基礎講座

エネルギーハーベスティングを用いた水インフラ災害対策技術

…………… 渦巻拓也

ホットといき

シンクライアントシステムの内製と運用…………… 浅野義直

色と光のミニギャラリー…………… 田所利康

Science As Art

白金膜の不思議な渦巻き…………… 乙津和希

一般社団法人日本光学会 賛助会員

2020年12月17日現在の本会賛助会員は下記のとおりです。掲載させていただくとともに、本会事業に対するご賛助に厚く感謝の意を表します。

ウシオ電機株式会社	株式会社東芝
株式会社 AAC Technologies Japan R&D Center	株式会社東精エンジニアリング
株式会社エクモス	株式会社トプコン
オプトシリウス株式会社	トヨタ自動車株式会社
株式会社オプトロニクス社	株式会社ナック イメージテクノロジー
オリンパス株式会社	株式会社ニコン
キヤノン株式会社	株式会社ニデック
京セラ SOC 株式会社	日本板硝子株式会社
株式会社清原光学	一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
株式会社光学技研	浜松ホトニクス株式会社
興和株式会社	華為技術日本株式会社
株式会社五藤光学研究所	Phase One Japan 株式会社
コニカミノルタ株式会社	富士フイルム株式会社
株式会社三恵舎	古野電気株式会社
株式会社シグマ	株式会社溝尻光学工業所
Zemax Japan 株式会社	三菱ケミカル株式会社
ソーラボジャパン株式会社	山村フォトニクス株式会社
株式会社タムロン	株式会社リコー
チームオプト株式会社	ルーメスソフト株式会社
中央精機株式会社	以上 会員数 39 社, 53 口 (五十音順)